

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成23年4月21日(2011.4.21)

【公開番号】特開2010-43317(P2010-43317A)

【公開日】平成22年2月25日(2010.2.25)

【年通号数】公開・登録公報2010-008

【出願番号】特願2008-207609(P2008-207609)

【国際特許分類】

C 2 1 C 5/46 (2006.01)

F 2 7 D 21/00 (2006.01)

G 0 1 N 33/20 (2006.01)

【F I】

C 2 1 C 5/46 D

F 2 7 D 21/00 D

G 0 1 N 33/20 C

【手続補正書】

【提出日】平成23年3月9日(2011.3.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

転炉のサブランスにプローブを装着するに際して、プローブ装着時にサブランスを把持するサブランスホルダーが以下の手順によってサブランスを把持することを特徴とする転炉サブランスへのプローブ装着方法。

(a) サブランスホルダーに、サブランスを把持できたか否かを検出するセンサを設置しておく、

(b) サブランス把持完了タイミング時に、前記センサで、サブランスを把持できたかを検出し、

(c) サブランスを把持できなかったセンサ出力の場合には、

(c-1) そのタイミングの状態を、所定時間継続し、

(c-2) サブランスホルダーの後退→開→前進→閉の動作を行うことで、サブランスを把持する。

(d) 上記(c-2)でもサブランスを把持できない場合は、上記(b)～(c)を繰り返す。